



(11) Publication number:

02

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **01120179**

(51) Intl. Cl.: G01B 11/00

(22) Application date: 11.05.89

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

07.12.90

(84) Designated contracting

states:

(72) Inventor: AKISHIBA YUUJI

HIRAI MAKOTO

(71) Applicant: **KEYENCE CORP**

(74) Representative:

(54) METHOD AND DEVICE FOR MEASURING DISPLACEMENT OF **OBJECT**

(57) Abstract:

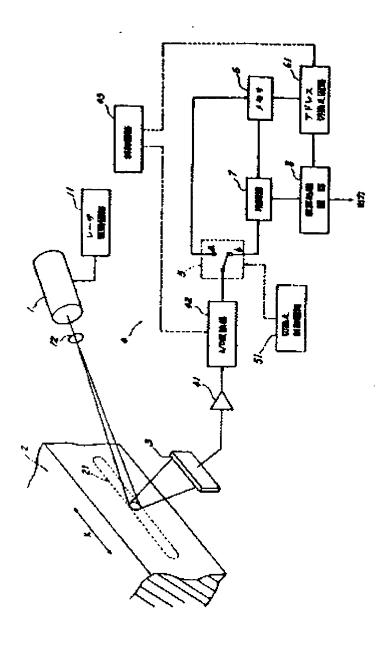
PURPOSE: To execute the measurement with high accuracy even if the displacement quantity is large by collating successively a measured image signal obtained at the time of measurement and plural scanning image signals stored in a memory and outputting a signal for showing a mutual correlation function.

CONSTITUTION: The surface of a moving object 2 is irradiated by a laser beam, and a one-dimensional image sensor (that which is formed by arranging a CCD along the moving direction X of the object 2) 3 is placed so as to be opposed to the irradiated surface 21. As a result, the observation surface of a speckle pattern is formed. An image signal brought to photoelectric conversion

Best Available Copy

by the sensor 3 is brought to A/D conversion 42, and stored successively to a memory 6. A correlator 7 calculates immediately a mutual correlation function of a digital signal for showing a speckle pattern of one scanning point read out of the memory 6, and a digital signal for showing a speckle pattern in one measuring point sent from the A/D converter 42. A result of this calculation is sent to an arithmetic processing circuit 8, and the circuit 8 outputs a signal corresponding to a moving amount of the object 2, based on address data sent from an address switching circuit 61.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-297006

9 Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月7日

G 01 B 11/00

H

7625-2F

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全7頁)

50発明の名称

物体の変位測定方法及び装置

頭 平1-120179 2)特

願 平1(1989)5月11日 223出

秋 柴 ⑫発 明 者

大阪府高槻市明田町 2番13号 株式会社キーエンス内

大阪府高槻市明田町 2番13号 株式会社キーエンス内

⑫発 明 考 亚 # 銊

大阪府高槻市明田町 2番13号

⑪出 頭 人 株式会社キーエンス

79代 理 人

弁理士 丸山 敏之

外1名

1. 発明の名称

物体の変位測定方法及び装置

- 2. 特許請求の範囲
 - ① 測定の対象となる物体(2)の表面をレーザビ ームにて物体移動方向に走査し、該物体(2)の レーザ照射面(21)に対向した観測面に現れるス ペックルパターンをイメージ信号に変換し、前 記走査に伴って変化するイメージ信号を、前記 レーザ照射面(21)上のレーザピームの照射位置 と対応づけてメモリ(6)の複数の格納部に順次 格納した後、物体(2)の変位測定時に、前記観 湖面に現れるスペックルパターンのイメージ信 号と、前記メモリ(6)の各格納部に格納されて いる複数のイメージ信号との相互相関関数を算 出し、最大の相関ピーク値が得られるイメージ 信号のメモリ(6)内の格納位置に基づいて、物 体(2)の変位を検知することを特徴とする物体 の変位測定方法.
- ② 測定対象物体(2)の表面をレーザピームにて

走査する過程で、観測面に現れる1時点のスペ ックルパターンをメモリ(6)に格納した後、該 スペックルパターンと、その後の走査に伴って 変化するスペックルパターンとの相互相関関数 を繰り返し算出し、相関ピーク値が所定値を下 回った時点で、レーザピームが照射している位 置のスペックルパターンをメモリ(6)内の次の 格納位置に格納する動作を繰り返して、メモリ (6)内に脳次スペックルパターンを記憶する特 許請求の範囲第1項に記載の変位測定方法。

- ③ 移動物体(2)の変位測定時に、最大の相関ビ ーク値が得られるイメージ信号のメモリ(6)内 の格納位置に基づいて、移動物体(2)の移動量 を一定の製差範囲内で検知し、更に前記イメー ジ信号と観測面に現れるスペックルパターンの イメージ信号との相互相閲閲数のピーク位置を 検知し、前紀両検知に基づいて、移動物体(2) の変位量を高精度で算出する特許請求の範囲第 1 項に記載の変位測定方法。
- ④ 移動物体(2)の変位測定時に、最大の相関ビ

一ク値が所定値を上回った時点で、 該相関ビーク値算出の基礎となったイメージ信号のメモリ(6)内の格納位置に応じた出力信号を発生し、 該出力信号は、物体(2)の自動位置決めを行な う為の結構信号として利用する特許請求の範囲 第1項に記載の変位測定方法。

て、スペックルパターンの移動量が、前記相互相 関関数のピーク値の位置として得られる。

(解決しようとする課題)

ところが、従来の方法に於いては、変形前後の2つのスペックルパターンの相互相関にのみ基づいて測定が行なわれるから、測定精度の保証される変形範囲が、両スペックルパターンにある程度の相関性が維持される範囲内に限定される。

従って、従来の変形測定方法を応用して、移動 物体の変位量を測定する場合、変位量がレーザピームの直径よりも大きくなると、移動前後の2つのスペックルパターンの間には全く相関がなくなり、測定が不可能となる。又、変位量がピームなよりも小さい場合に於いても、変位量が大きくなるにつれて、測定精度が低下する問題が生じる.

本発明の目的は、変位量の大小に拘わらず、特度の高い測定が可能な移動物体の変位測定方法及び装置を提供することである。

(課題を解決する為の手段)

本発明に係る移動物体の変位測定方法は、実際

切換えスイッチ(5)と、相関器(7)の出力信号 に演算処理を施して物体の変位に応じた信号を 出力する演算処理回路(8)とから構成される物 体の変位測定装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、レーザ光を照射した対象物体祖面からの拡散光によって生じるスペックルバターンを 利用して、移動物体の変位量や所定の変位発生時 点を測定する方法、及びその装置に関するもので ある。

(従来の技術)

従来、スペックルパターンを応用して物体の微小な変形量を測定する方法が提案されている(特公昭59-52963号、J.Phys.E:Sci.Instrum,19,1986)。

技測定方法は、測定物体の表面にレーザピーム を照射して、拡散反射光の中にイメージセンサを 配置し、該センサ出力に基づいて、物体変形前後 の出力信号の相互相関関数を算出するものであっ

の測定前にレーザピームを移動物体に照射する走 査ステップと、その後、実際の測定時にレーザピ ームを移動物体に照射する実測ステップの 2 つの ステップから構成される。

走査ステップに於いては、移動物体(2)の表面にレーザピームを照射して、接移動物体(2)に対向した観測面にスペックルパターンを形成し、接スペックルパターンをイメージ信号に変換し、移動物体(2)の変位に伴って変化するイメージ信号を、移動物体(2)の変位量と対応づけて、メモリ(6)の複数の格納部に顧次格納する。

実測ステップに於いては、観測面に現れるスペックルパターンのイメージ信号と、メモリ(6)の各格納部に格納されている複数のイメージ信号との相互相関関数を類次算出し、最も大きな相関ピーク値が得られるイメージ信号のメモリ(6)内の格納位置に基づいて、移動物体(2)の変位を測定する。

又、本発明に係る物体の変位測定装置は、測定 対象となる物体の表面に向けてレーザビームを照

politica — well unit by a con-

射するレーザ発生原と、物体表面が放大のススページを受光し得る位置に配置されませるイメージを検出するイメージられてイメージのは出するイメージの相関性が立て、物体を受力がある。のは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、な

(作用)

本発明に係る測定方法に於いて、変位測定時には、物体(2)の移動につれて観測面に現れるスペックルパターンが変化し、変化中の一時点におけるスペックルパターンのイメージ信号と、メモリ

その後、変位測定時には、スイッチ(5)を相関器(7)側に切換えた状態で、対象物体の表面にレーザピームを照射すると、相関器(7)による相互相関関数の算出、演算処理回路(8)による物体変位に応じた信号の作成が行なわれ、本発明の測定方法における実測ステップが実行される。

(発明の効果)

本発明に係る移動物体の変位剤定方法及び装置によれば、物体の移動量がピームスポット径を超える場合に於いても、前記走査ステップにおけるレーザピームの走査範囲に応じて剤定範囲を拡大することが出来、この場合、メモリにイメージ信号として格納すべきスペックルバターンの間隔を可及的に小さくすることにより、剤定精度を上げることが可能である。

(実施例)

以下、図面に沿って本発明の実施例について説明する。

尚、実施例は本発明を説明するためのものであって、特許請求の範囲に記載の発明を限定し、或

(6)内に既に格納されている複数のスペックルパ ターンのイメージ信号との間の相互相関関数が順次、算出される。

この際、相互相関関数の算出の対象となったイメージ信号の格納位置に対応する物体の変位量と、測定時点における物体の実際の変位量との間に大きな差がある場合は、相互相関関数のピーク値は小さく、前記差が小さい場合には、相互相関関数のピーク値は大きくなる。

従って、最も大きな相関ピーク値が得られた場合のイメージ信号の格納位置に対応する物体変位量が、測定時点における物体の実際の変位量を表わすことになる。

又、本発明に係る測定装置を用いて上記測定方法を実施する場合は、先ずスイッチ(5)をメモリ(6)側に切り換えた状態で、対象物体の表面をレーザピームにて走査すると、これに伴って変化するスペックルパターンの走査イメージ信号が順次メモリ(6)に格納され、本発明の測定方法における走査ステップが実行される。

は範囲を減縮する様に解すべきではない。

第1図は、本発明の測定方法を用いて移動物体 (2)の平行移動量を測定するための装置構成を示 している。

移動物体(2)に対向して、レーザ駆動回路(11)によって駆動される半導体レーザ(1)が配備されている。 該半導体レーザ(1)から出射されたレーザ光はピーム拡大レンズ(12)を経て、移動物体(2)の表面に所定のピーム径(例えば1 mm)のレーザピームとなって照射される。

又、移動物体(2)のレーザ照射面(21)に対向して、拡散反射光を受け得る位置に一次元イメージセンサ(3)が配置される。該イメージセンサ(3)は、例えば1024個のCCD(電荷結合素子)を移動物体(2)の移動方向Xに沿ってピッチ14μmで一次元に配列したものであって、これによってスペックルパターンの観測面が形成される。

尚、一次元イメージセンサ(3)としては、フォ トダイオードを配列したものも使用可能である。

一次元イメージセンサ(3)にて光電変換された

イメージ信号は、測定回路(4)に装備した増幅器 (41)を経て A / D 変換器(42)へ送られ、 8 ピット のデジタル信号に変換される。

前記デジタル信号は、切換えスイッチ(5)の入力協へ接続され、該スイッチの一方の出力端aはメモリ(6)のデータ入力ポートへ接続される。又、メモリ(6)のデータ出力ポート及び前記切換えスイッチ(5)の他方の出力端は、相関器(7)へ接続される。

前記メモリ(6)は、A / D 変換器(42)から送られてくる移動物体(2)の一走査点におけるデジタル信号を格納すべき1024パイトの格納部を、第1番地から第N番地(N=600)まで具えている。 放メモリ(6)への信号の書込み及び信号の統出しは、アドレス切換え回路(61)によって後述の如く制御される。

又、前記相関器(7)は、メモリ(6)から読み出された一走査点のスペックルパターンを表わすデジタル信号と、A/D変換器(42)から切換えスイッチ(5)を経て送られてくる一測定点におけるス

メージ信号として、メモリ(8)に順次格納する走査ステップが実行される。この際、切換えスイッチ(5)はa側に切換えられる。

この過程でA / D 変換器 (42)は、制御回路 (43)の制御により一定周期で増幅器 (41)からのイメージ信号をデジタル信号に変換し、該デジタル信号を切換えスイッチ (5)を経てメモリ (6)へ供給する。

又、アドレス切換え回路(61)は、制御回路(43)の制御により前記A/D変換器(42)の動作周期に同期して、メモリ(6)のデータ格納アドレスを第1番地から第N番地まで順次切り換える。

この結果、切換えスイッチ(5)を経て一定周期でメモリ(6)へ供給されるデジタル信号は、第3 図に示すメモリ(6)内の第1番地から第N番地までの格納部(M₁、M₂、… MI、… M₀)へ順次格納されることになる。

この様にしてメモリ(6)内に格納された複数の デジタル信号(Pi、Fi、…Fi、…Pn)は、第3 図の如くレーザ照射面(21)上に互いに重なって一 ペックルパターンを表わすデジタル信号との相互 相関関数をリアルタイムで計算するものである。

前記A/D変換器(42)及びアドレス切換え回路(61)の動作タイミングは制御回路(43)によって後述の如く制御される。

相関器(7)から得られる相互相関関数の計算結果はマイクロコンピュータ等からなる演算処理回路(8)などられる。 旅演算処理回路(8)は、前記計算結果とアドレス切換え回路(61)から送られてくる後述のアドレスデータとに基づいて、移動物体(2)の移動量に応じた信号を出力するものである。

以下、上紀変位測定装置を用いた測定方法と、 前紀各回路の動作について説明する。 <u>走査ステップ</u>。

先ず、実際の変位測定の前に、移動物体(2)を その全移動範囲に直って一定速度で移動させつつ、 移動物体(2)に半導体レーザ(1)からのレーザピ ームを服射して、レーザ照射面(21)からの拡散反 射光によって形成されるスペックルパターンをイ

定ピッチ(例えば 0 . 5 mm) で形成される N 個の走査スポット領域 (A i、A i、… A i、… A n) の報面状態に対応して、夫々固有のスペックルパターンを表わすことになる。

尚、上述の走査ステップは、物体(2)を静止させた状態で、光源及びイメージセンサからなる測定系を物体移動方向に沿って移動させることによっても可能である。

先ず第1因の切換えスイッチ(5)をa側に切り 換え、この状態で第1番目のスポット領域Aiに ・レーザビームを照射する。これによって接領域の スペックルパターンがメモリ(6)の第1番地に格 納される。

その後、切換え制御回路(51)によってスイッチ(5)がb側に切り換えられ、この状態でレーザ照射位置を徐々に移動させる。これによって、実調スペックルパターンと前記メモリ内の第1番地の走査スペックルパターンとの相関関数が繰り返し計算され、この結果得られる相関ピーク値が所定値を下回る時点、即ち両スペックルパターンの相関がとれ難くなる前の時点が検出される。このときの相関ピーク位置からレーザ照射位置の変位量が計算される。

これと同時に切換え制御回路(51)によってスイッチ(5)がa側に切り換えられ、A / D 変換器(42)から得られるイメージデータを、第 3 図の第 2 番目の走査スポット領域 A aのスペックルパターンとしてメモリ(6)の第 2 番地に格納すると共に、前記レーザ照射位置の変位量の計算結果を記憶する。

実測ステップ

次に移動物体(2)の移動量の実遡ステップに移る。この際、切換えスイッチ(5)は第1図の如く b側に切り換えられ、相関器(7)及び演算処理回路(8)が更に動作状態に設定される。

例えば移動物体(2)がある変位量だけ移動し、第3図の如く、レーザピームが照射面(21)上のスポット領域AI'を照射した時点で、類変位量を測定する場合、第1図の一次元イメージセンサ(3)から増幅器(41)を経てリアルタイムで得られるイメージ信号は、A/D変換器(42)にてデジタル信号に変換された後、切換えスイッチ(5)を経て相関器(7)へ送られる。

一方、アドレス切換え回路(61)の動作によって、メモリ(6)からは、第3図の如く第1番地の格納部Miから第N番地の格納部Mnに格納されているデジタル信号(Fi、Fi、…Fi、…Fn)が順次読み出され、相関器(7)へ一定周期で送られる。

相関器(7)は、前紀切換えスイッチ(5)を経て供給されたデジタル信号Gと、前紀メモリ(6)か

以後同様に、最新にメモリへ格納されたスペックルパターンを基準として、相関ピーク値の低下により、次の走査スポット領域となるべき位置が検知されると共に、該走査スポット領域と直前の走査スポット領域との間隔を記憶する動作が繰り返される。

この結果、第3図の各走査スポット領域(Aı、Aı、・・・Ai、・・・An)のスペックルバターンがメモリ内に設定されると共に、各走査スポット領域の間隔が記憶されることになる。

尚、上記走査ステップに於いて、相関性が維持され難くなる直前の時点を検出し、単にその時点のスペックルパターンを記憶する動作を繰り返すことによっても、略一定ピッチで第3図の走査スポット領域(Aı、Aı、・・・Ai、・・・An)が設定されるから、走査スポット領域の変位量の算出は必ずしも必要でない。即ち、走査ステップにおける全走査及とメモリに格納されるスペックルパターンの数から、走査スポット領域の間隔(ピッチ)を近似値として算出するのである。

ら送られてくるデジタル信号との相互相関関数を 順次計算し、計算結果を次々と第1図の演算処理 同路(8)へ送り出す。

演算処理回路(8)は、相関器(7)から送られてきたN個の相関関数の内、最大の相関ピーク値が得られた相関関数を選択し、該相関関数の計算の対象となったメモリ(6)内のデジタル信号Fiの格納アドレスを、アドレス切換え回路(61)からのアドレスデータによって検知する。

ここで最大の相関ピーク値が得られた相関関数の計算の基礎となったスペックルパターンは、実際にレーザピームが照射されている測定スポット領域Air と重なり且つ最も重複面積の大きい走査スポット領域Air ついてのスペックルパターンである。従って、前記デジタル信号Fiの格納アドレスに対応する走査スポット領域の位置として、測定スポット領域Air の位置を前記走査スポットピッチ(0.5 mm)から一定誤差範囲内で割り出すことが出来る。

尚、前述の如く走査ステップにて、各走査スポ

"ット領域の間隔が耐定され記憶されている場合、 或は設間隔の近似値が判明している場合は、実測 開始以後のスポット領域間隔を読み出して積算す ることによって、測定スポット領域 A L'の位置 を算出することが可能である。

又、演算処理回路(8)は、最大の相関ピーク値が得られた相互相関関数の分布から、第5回に示すピーク位置をを求め、該ピーク位置をに基づいて、第4回に示す走査スポット領域 Aiと測定スポット領域 Aiと 別定スポット領域 Ai' との位置ずれ Δ X を算出する。

更に演算処理回路(8)は、前記走査スポット領域 Aiの位置として割り出された移動量の計算結果に対し、前記位置ずれ Δ X に基づく補正を施すことにより、測定スポット領域 Ai'の位置、即ち移動物体(2)の移動量を正確に計算し、その結果を出力する。

前記出力信号は、例えば表示器(図示省略)へ供給して、移動量をデジタル表示することが可能である。

又、上記測定装置をロポットアーム等の自動位

ット領域のビッチを可及的に小さくすることによって、 御定精度を上げることが出来る。

尚、図面及び上記実施例の説明は、本発明を説明するためのものであって、特許請求の範囲に記載の発明を限定し、或は範囲を減縮する様に解すべきではない。

又、本発明の各部構成は上紀実施例に限らず、 特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変 形が可能であることは勿論である。

例えば、第1図の一次元イメージセンサ(3)を 二次元イメージセンサに置き換えれば、物体(2) の二次元方向の変位量を測定することが可能であ る。

又第2図に示す様に、ドラム状の回転物体(23)の外周面(24)にレーザピームを照射すれば、該回転物体(23)の回転角度を測定することが出来、これによってロータリーエンコーダを構成することも可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る変位測定装置の構成例を

置決め装置に応用する場合は、演算処理回路(8) によって第5図に示す位置ずれるが零になった時 点を検知して、旋検知信号を制御対象となるモー タ駆動回路等へ供給すれば、高精度の位置決めが 可能となる。

尚この場合、走査ステップにて、位置決めの目標となる各位置に夫々走査スポット領域を設定しておくことにより、演算処理回路(8)は、最大はこれ間ピーク値が所定値を上回った時点、例えば正規化された相関ピーク値が略1となった中央に受ける。 がある。 がある。 は、第5回に示すピーク位置のずれに基づく移動量の算出は省略出来る。

本発明に係る変位測定方法によれば、前配走査ステップを1回実行すれば、その後は実測ステップのみを実行することにより、移動物体(2)に対して特別なスケール等を取り付けることなく、然も非接触にて、移動物体(2)の変位をリアルタイムで測定出来る。この際、第3回に示す走査スポ

・示す図、第2図は変位測定装置の他の構成例を示す図、第3図は実剤ステップでの装置動作を説明する図、第4図はピームスポットの位置ずれを示す図、第5図は相関器から得られる相互相関関数を示すグラフである。

(1)…半導体レーザ

(3) … イメージセンサ

(4)…測定回路

(6)…メモリ

(7)…相関器

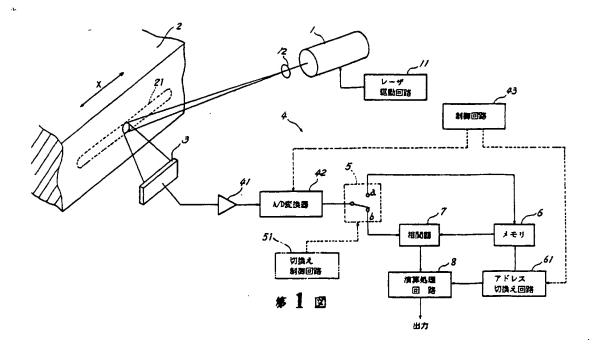
(8)…演算処理回路

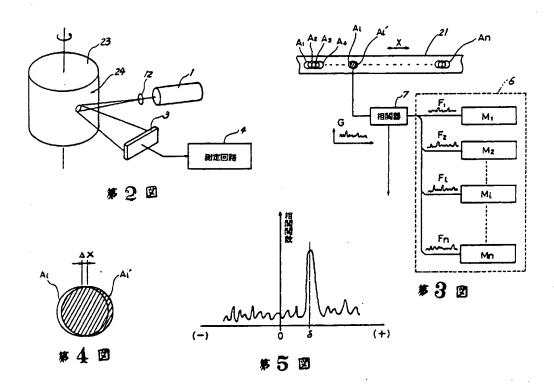
出顧人 株式会社 キーエンス

代理人 弁理士 丸 山 敏



元和 代理人 弁理士 丸 山 信 子(2)1至 12年





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.